



扣件尺寸量測之量測追溯要求

文件編號：TAF-CNLA-J11(6)

文件類別：認證通報

日期：2021年5月OO日

適用範圍：申請及認可扣件尺寸量測(項目代碼：0103M017)之實驗室

內容：

1.扣件尺寸量測所使用之設備/量具，除一般常用之卡尺、分厘卡、指示量錶、影像量測儀、投影儀等應符合本會認證共通規範「測試與校正實驗室能力一般要求」(TAF-CNLA-R01) 與「量測結果之計量追溯政策」(TAF-CNLA-R04)之有關量測追溯要求外，另外一些特殊之設備/量具，包括環規、塞規、深度量具、轉盤式頭厚機等之量測追溯，則應符合下表所列方式要求：

設備/量具	量測追溯方式	查核/校正週期
可調式螺紋環規 Adjusted (Split) Thread Ring Gage	螺紋環規以螺紋塞規(或稱螺紋柱規、螺紋栓規、牙規)查核，或由認可校正實驗室校正。	實驗室依使用頻率及狀況訂定/調整查核週期。
固定式螺紋環規 Solid Thread Ring Gage	螺紋環規以螺紋塞規(或稱螺紋柱規、螺紋栓規、牙規)查核，或由認可校正實驗室校正。	實驗室依使用頻率及狀況訂定/調整查核週期。
螺紋塞規 (或稱螺紋柱規、螺紋栓規、牙規) Thread Plug Gage	螺紋塞規由認可校正實驗室校正，或由實驗室以經認可校正實驗室校正過之標準件，如針規(或稱線規)及分厘卡執行內部校正。	實驗室依使用頻率及中間查核狀況訂定/調整校正週期。



深度量具 (或稱 Q 規) Recess Penetration Gage	深度量具之指示量錶由認可校正實驗室校正，或由實驗室以經認可校正實驗室校正過之標準件執行內部校正。	實驗室依使用頻率及狀況訂定/調整校正週期。
轉盤式頭厚機 Protrusion Height Gage	轉盤式頭厚機之孔徑由認可校正實驗室校正，或由實驗室經認可校正實驗室校正過之標準件執行內部校正。	實驗室依使用頻率及狀況訂定/調整校正週期。

2. 當上述表列之設備/量具由認可校正實驗室校正時，須符合本會認證共通規範「量測結果之計量追溯政策」(TAF-CNLA-R04)有關測試實驗室測試結果追溯之要求。
 3. 當上述表列之設備/量具由實驗室執行內部校正時，須符合本會認證共通規範「量測結果之計量追溯政策」(TAF-CNLA-R04)、技術規範「內部校正特定規範」(TAF-CNLA-T18)有關內部校正追溯之要求，其中環境溫度至少須管控在 $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$ 範圍內。
 4. 上表中之設備/量具，實驗室得參考 ISO/IEC 17025:2017 第 6.4.10 節及「儀器校正週期決定原則」(TAF-CNLA-G20)，依使用頻率及狀況，或安排中間查核以適當調整校正/查核週期。若實驗室具備三針法或直接量測法之能力，於兩次校正間可安排一次/多次中間查核，以確認螺紋塞規之有效徑與外徑皆符合管制界限，則可適當延長校正週期。實驗室之中間查核須具備程序且於評鑑時展現其能力，並完整建檔保存相關查核紀錄。
 5. 中間查核用之標準件/設備/量具，應符合本會認證共通規範「測試與校正實驗室能力一般要求」(TAF-CNLA-R01) 與「量測結果之計量追溯政策」(TAF-CNLA-R04)之有關量測追溯要求。中間查核之環境溫度至少須管控在 $(20 \pm 3)^\circ\text{C}$ 範圍內。對於螺紋環規、螺紋塞規之中間查核紀錄，建議實驗室使用適合之品管手法(如管制圖)，以明確了解查核結果之變化程度與管制界限之關係。
- 2021.05.xx
- 說明：認證通報為解釋或說明認證規範的文件，提供認證規範於實務運用上的資訊。
- 第 2 頁共 3 頁



範例一：實驗室於外螺紋量測之認可範圍為(#6 to 1 1/4) in、M3 to M30，螺紋環規各規格之使用頻率有高有低，惟全部規格之查核週期皆訂定為半年。其中 1/2 in 及 M10 以下之使用頻率低，建議實驗室可將使用頻率低之螺紋環規查核週期調整為一年。

範例二：實驗室之螺紋塞規(設定、GO、NOT GO、磨耗點檢)，可依範例一之使用頻率狀況調整校正週期。

相關規範及指引文件：

1. TAF 認證共通規範「測試與校正實驗室能力一般要求」(TAF-CNLA-R01)
2. TAF 認證共通規範「量測結果之計量追溯政策」(TAF-CNLA-R04)
3. TAF 認證技術規範「內部校正特定規範」(TAF-CNLA-T18)
4. 量測儀器校正週期決定原則 (TAF-CNLA-G20)

聯絡人：本會實驗室認證一處 賀瑞庭 聯絡電話:(03) 533- 6333 轉 207

實施日期：本文件發佈日起實施。